



フォトルミネッセンス

WT-2000PL

WT-2000PLは、フォトルミネッセンス測定と反射率測定によりGaNなどのワイドギャップ半導体中の欠陥と汚染を高速・高解像度で測定する装置です。非接触測定により、LEDなどの品質検査が容易に行えます。

特徴

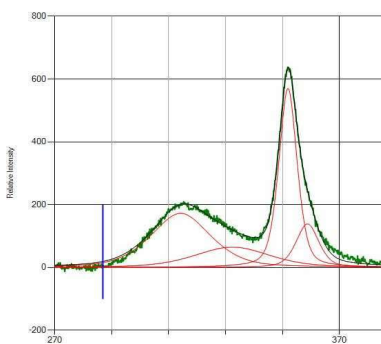
- 高速スループット
- 高解像度ウェハーマップ
- 波長スキャンPL
- レーザー波長選択可能

主な測定・評価項目

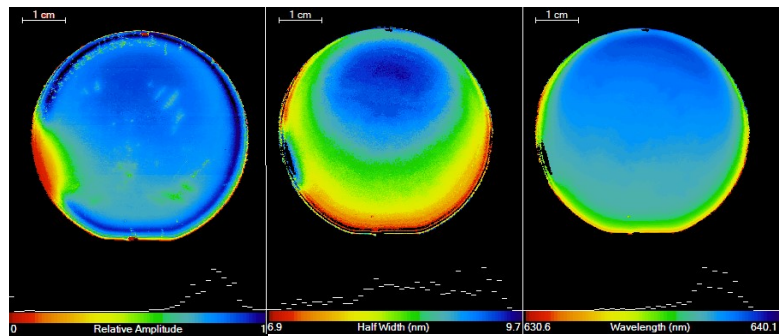
- フォトルミネッセンス測定
- 反射率測定
- 結晶欠陥・汚染測定
- エネルギーギャップ測定
- 結晶度測定



測定データイメージ



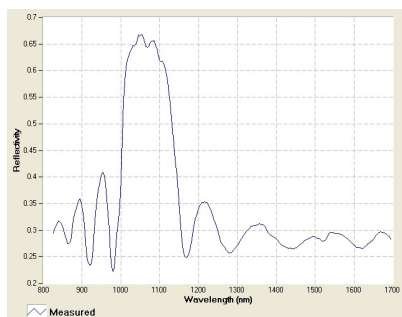
PL測定



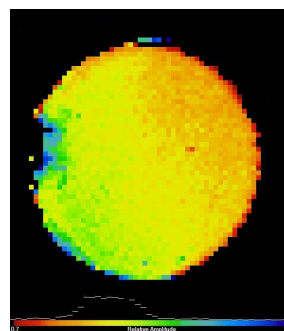
PL intensity map

FWHM map

Gap Energy map



反射率測定



Spectroscopic Reflectivity map [R max]

